

小型桌上型高频等离子表面处理装置



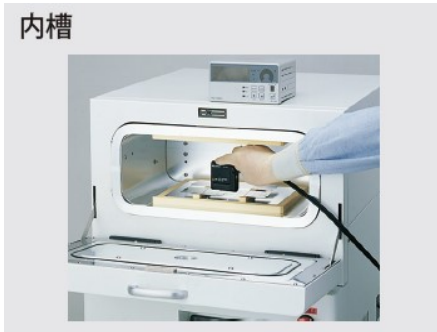
■ 操作性 · 功能

- 射频 13.56Mhz 0-300W 高功率机型，发生器自动匹配，无需调节反射波，进一步增加的操作的便捷性。
- 标准配备数字式皮拉尼传感器，实时显示真空度，使得控制更为精确。
- 平行平板腔体非常适合于实验室处理比较纯净的晶圆、硅片等样品，无需担忧因为腔体材质的原因导致样品受到污染。

■ 安全性 · 保护

- 装载有温度、压力、等离子发生器异常等三层报警灯，可实时监测和了解机器的运转状态。
- 装载有过电流漏电保护开关、自诊断回路、异常时蜂鸣器报警等安全功能。

内槽



■ 产品优势

- 等离子清洗机清洗效果好，清洗效率高，功率大，应用范围广。
- 对清洗样品，没有任何材质、外观尺寸等要求。
- 等离子清洗过程中，温升很小，基本可达到常温处理。
- 高效的特制电极，是产生均匀等离子体的保证。
- 特制电极和托盘结构，可保证样品可得到全面有效的清洗。

■ 规格

型号	PDC200	
方式	RIE 模式、平行平板腔体	
性能	发生器功率：	0-300W
	发生器频率：	射频 RF13.56Mhz
	发生器匹配方式：	自动匹配 (Auto matching)
构成	腔体材质：	铝制
	腔体内尺寸：	W400×D250×H150mm
	反应气体：	二路工艺气体，可支持氧气、氩气、氮气等非腐蚀性气体。
	控制方式：	全自动控制
	真空度显示：	数字式皮拉尼传感器，实时显示腔体内真空度。
	配管材质：	SUS 不锈钢以及特氟龙
	门：	铰链门
	外形尺寸：	W540×D600×H600mm
	真空泵抽速：	4m ³ /hour
	电源规格：	AC220V 10A
重量：	约 100kg	